



FPD 露光装置

FX-66S2/66S

第6世代プレートサイズ対応

高生産性を実現した3 μ m 解像度 FPD 露光装置



第6世代プレートサイズ対応 高生産性を実現した3 μm 解像度FPD露光装置

FPD露光装置 FX-66S2/66S

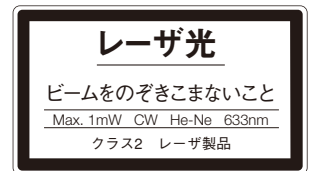
第6世代のプレートによる中小型パネルの生産に対応したFPD露光装置です。
高い生産性と安定した露光性能で、3 μm (L/S)以下の解像度による中小型パネルの量産を実現します。

特長

- マルチレンズシステムを搭載
複数の投影レンズで構成されたマルチレンズシステムを搭載。
広い露光領域を確保すると同時に、高解像度を達成。
- 高スループット
- 高解像度
マルチレンズシステムとニコン独自のフォーカス制御システムにより、プレート全面で3 μm (L/S)以下の高解像度を実現。
- 高い重ね合わせ精度
多点同時アライメントの採用と高精度ステージにより、重ね合わせ精度 $\pm 0.6 \mu\text{m}$ 以下を実現。
- 露光性能の向上
独自技術により開発したさまざまなキャリブレーション機能を適用し、総合的により安定した露光性能を実現。

Performance

	FX-66S2	FX-66S
解像度(L/S)	3.0 μm (g+h+i-line)	
投影倍率	1:1	
重ね合わせ精度	$\leq \pm 0.6 \mu\text{m}$	
最大プレートサイズ	1,500 mm \times 1,850 mm	
タクトタイム	53 sec./plate Conditions: 1,500 mm \times 1,850 mm, 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm ²	55 sec./plate Conditions: 1,500 mm \times 1,850 mm, 4 scans, g+h+i-line, 30 mJ/cm ²



安全に関するご注意

■ご使用前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご注意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

・このカタログは2018年3月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。
・このカタログに掲載の会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

©2018 NIKON CORPORATION

株式会社 **ニコン**

半導体装置事業部 営業部 108-6290 東京都港区港南2-15-3 品川インターシティ C棟 電話(03)6433-3641

株式会社ニコンテック 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911

<http://www.nikon.co.jp/pec>